

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第1区分
 【発行日】平成20年8月21日(2008.8.21)

【公表番号】特表2004-516127(P2004-516127A)
 【公表日】平成16年6月3日(2004.6.3)
 【年通号数】公開・登録公報2004-021
 【出願番号】特願2002-506067(P2002-506067)
 【国際特許分類】

B 0 1 J 19/00 (2006.01)

G 0 1 N 37/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 19/00 3 2 1

G 0 1 N 37/00 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月30日(2008.6.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 サンプル処理アセンブリにおいて、
 第2側に取り付けられた第1側を備える本体と、
 前記第1側と前記第2側との間に形成される複数のプロセスアレイであって、各々が、装填構造体、長さを有する主導管、該主導管に沿って分布した複数のプロセスチャンバ、および該装填構造体と該複数のプロセスチャンバとの間に配置された変形可能なシールを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通している複数のプロセスアレイと、
 を備えるサンプル処理装置と、
 前記サンプル処理装置に取り付けられるキャリアであって、
 前記サンプル処理装置に対向する第1表面および前記サンプル処理装置から離背する第2表面と、
 前記第1表面に近接した複数の主導管支持レールであって、前記複数のプロセスアレイの各々の前記主導管が1つの主導管支持レールに対し整列配置されるようになっている複数の主導管支持レールと、
 前記第1表面および前記第2表面を通して形成された複数の開口部であって、各々が前記複数のプロセスチャンバの1つに対し整列配置されるようになっている複数の開口部と、
 を備えるキャリアと、
 を具備することを特徴とするサンプル処理アセンブリ。

【請求項2】 サンプル材料を処理する方法において、

第2側に取り付けられた第1側を備える本体と、前記第1側と前記第2側との間に形成される複数のプロセスアレイであって、各々が、装填構造体、長さを有する主導管、該主導管に沿って分布した複数のプロセスチャンバを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通している複数のプロセスアレイと、を備えるサンプル処理装置と、前記サンプル処理装置に取り付けられるキャリアであって、前記サンプル処理装置に対向する第1表面および前記サンプル処理装置から離背する第2表面と、前記第1表面および前記第2表面を通して形成された複数の開口部であって、各々が前記複数の

プロセスチャンバの1つに対し整列配置されるようになっている複数の開口部と、を備えるキャリアと、を具備するサンプル処理アセンブリを用意することと、

前記複数のプロセスアレイの各々の前記主導管を通して、前記複数のプロセスアレイの各々における前記プロセスチャンバの少なくともいくつかにサンプル材料を分配することと、

前記サンプル処理装置の前記第2側を熱ブロックに接触させて配置することと、

前記複数のプロセスチャンバの各々に近接して、前記キャリアと前記熱ブロックとの間で、前記サンプル処理装置の前記第1側と前記第2側とを共に選択的に圧縮することと、

前記サンプル処理装置が前記熱ブロックに接触している間に前記熱ブロックの温度を制御することと、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項3】 サンプル処理アセンブリにおいて、

第2側に取り付けられた第1側を備える本体と、

前記第1側と前記第2側との間に形成される複数のプロセスアレイであって、各々が、装填構造体、長さを有する主導管、該主導管に沿って分布した複数のプロセスチャンバを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通している複数のプロセスアレイと、

を備えるサンプル処理装置と、

前記サンプル処理装置に取り付けられるキャリアであって、

前記サンプル処理装置に対向する第1表面および前記サンプル処理装置から離背する第2表面と、

前記第1表面および前記第2表面を通して形成された複数の開口部であって、各々が前記複数のプロセスチャンバの1つに対し整列配置されるようになっている複数の開口部と

、

前記第1表面に近接した複数の圧縮構造体であって、各々が前記複数のプロセスチャンバの1つに近接している複数の圧縮構造体と、

を備えるキャリアと、

を具備することを特徴とするサンプル処理アセンブリ。

【請求項4】 第1側と第2側との間に形成される複数のプロセスアレイであって、各々が、装填構造体、長さを有する主導管、該主導管に沿って分布した複数のプロセスチャンバを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通している複数のプロセスアレイと、1つの該プロセスアレイにおける該装填構造体と該複数のプロセスチャンバとの間に各々が配置される複数の変形可能なシールとを備えるサンプル処理装置の、該変形可能なシールを閉鎖するための装置において、

前記サンプル処理装置を受容するようになっているキャビティを備える基部と、

前記基部に動作可能に取り付けられるブリッジであって、前記キャビティに受容されたサンプル処理装置を第1方向に沿って横断できるブリッジと、

前記ブリッジに装着される複数のシール構造体であって、各々が、前記サンプル処理装置の一部を変形して前記変形可能なシールの1つを閉鎖するようになっている複数のシール構造体と、

を具備し、

前記複数のシール構造体は、前記第1方向に沿って整列し、前記複数のシール構造体によって各主導管が順次変形されるようになっていることと、

を特徴とする装置。